# Электронная структура и эффективные массы электронов и дырок в *а*- и *β*-фазах нитрида кремния

© А.В. Шапошников, И.П. Петров, В.А. Гриценко, С.W. Кіт\*

Институт физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук, 630090 Новосибирск, Россия \* R&D Center Samsung Electronics Co., Ltd, Process Development/Semiconductor San #24, Nongseo-Ri, Kiheung-Eup, Yongin-City, Kyunggi-Do, Korea

E-mail: grits@isp.nsc.ru

(Поступила в Редакцию 13 декабря 2006 г.)

Из первых принципов рассчитана электронная зонная структура двух основных кристаллических модификаций нитрида кремния  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> и  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Полученные оценки для эффективных зарядов атомов Si и N и эффективных масс электронов и дырок в  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> хорошо согласуются с экспериментальными данными для аморфного нитрида. Расчеты предсказывают существенное отличие тензора эффективных масс для  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> по сравнению с  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>.

Работа поддержана проектом РФФИ № 06-02-16621, Интеграционным проектом № 97 Сибирского отделения Российской академии наук и Корейским министерством науки и технологии по программе терабитных приборов.

PACS: 77.22.Jp, 77.55.+f, 77.84.Bw

#### 1. Введение

Двуокись (SiO<sub>2</sub>) и нитрид (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) кремния являются основными диэлектриками в кремниевых приборах [1,2]. В аморфном нитриде кремния (*a*-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) имеется высокая ( $\approx 10^{19}$  cm<sup>-3</sup>) концентрация электронных и дырочных ловушек. Инжектированные из кремния электроны и дырки захватываются на глубокие ( $\approx 1.5 \text{ eV}$ ) ловушки в Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> (эффект памяти). Время жизни электронов и дырок в локализованном состоянии превышает 10 лет при 85°C. В настоящее время этот эффект широко используется при разработке энергонезависимой быстродействующей (флэш) памяти [2,3]. Инжекция электронов и дырок в нитрид осуществляется туннельным механизмом. Темп инжекции электронов и дырок экспоненциально зависит от величин электронных  $m_e^*$  и дырочных  $m_h^*$  эффективных масс в Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> [4–7].

В кристаллическом состоянии нитрид существует в виде  $\alpha$ - и  $\beta$ -фаз. Низкотемпературная  $\alpha$ -фаза переходит в энергетически более выгодную  $\beta$ -фазу при температуре 1723°С. Решетки  $\alpha$ - и  $\beta$ -фаз нитрида кремния обладают гексагональной симметрией. Ближний порядок определяется тетраэдрическим окружением атома кремния (SiN<sub>4</sub>). Атомы азота N координированы тремя атомами кремния, лежащими приблизительно в одной плоскости. Структурные параметры различных модификаций Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> к настоящему моменту надежно определены экспериментально.

Элементарная ячейка  $\alpha$ -фазы содержит 28 атомов (12 — Si и 16 — N) и имеет постоянные решетки a = 7.75 Å, c = 5.62 Å (рис. 1) [8]. Ячейка  $\beta$ -фазы содержит 14 атомов (6 — Si, 8 — N), постоянные решетки a = 7.71 Å, c = 2.91 Å (рис. 1) [9]. Средние значения углов Si–N–Si составляют 119°9′ в  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> и 118°8′ в

 $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Плотности веществ различаются незначительно. С точки зрения атомной структуры,  $\alpha$ -фаза наиболее близка аморфному нитриду a-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> [1].

В [10] из первых принципов была рассчитана электронная зонная структура  $\alpha$ - и  $\beta$ -фаз нитрида кремния. Авторы отмечают, что зонные структуры обеих фаз очень близки и основные свойства электронной структуры определяются практически полностью ближним порядком. В работе были получены аномально большие значения для дырочной эффективной массы в  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>:  $m_h^* \approx 2.5 - 3.5 m_e$ . Экспериментальные зна-



**Рис. 1.** Элементарные ячейки  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> (*a*) и  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> (*b*).

чения эффективных масс как электронов, так и дырок в аморфном нитриде лежат в диапазоне  $m_{\rm e}^* \approx m_{\rm h}^* \approx (0.4-0.5)m_{\rm e}$  [4–7].

В работе [10] рассчитанный перенос заряда по связи Si–N составил  $\Delta = 0.70e$ , что вдвое превышает экспериментальное значение  $\Delta = 0.35e$  в аморфном Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> [1]. В работе [11] в  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> было получено значение дырочной эффективной массы  $m_h^* \approx (0.55m_0)$ , близкое к экспериментальной величине, однако эффективные массы для электронов вдвое больше экспериментальных значений для a-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Перенос заряда по связи Si–N составил  $\Delta = 0.63e$ , что существенно превышает экспериментальное значение 0.35e [1]. Было обнаружено заметное отличие эффективных масс в  $\alpha$ - и  $\beta$ -модификациях.

Следует отметить, что, насколько известно авторам, экспериментального изучения эффективных масс и эффективных зарядов в кристаллических модификациях не проводилось. В то же время известно, что средние значения тетраэдрических углов N–Si–N и межатомных расстояний Si–N в аморфном нитриде близки к соответствующим величинам в кристаллической  $\alpha$ -фазе. Трудность в теоретическом моделировании из первых принципов аморфной структуры приводит к тому, что в большинстве работ вместо нее используется кристаллическая  $\alpha$ -фаза. Как показывают наши расчеты, это приближение во многих случаях реализуется очень хорошо.

Целью настоящей работы является теоретическое изучение электронной структуры и уточнение значений эффективных зарядов и эффективных масс дырок и электронов в  $\alpha$ - и  $\beta$ -фазах нитрида кремния на основе *ab initio* расчетов.

# 2. Методы расчета

Зонные расчеты электронной структуры проводились с использованием программного пакета Quantum-Espresso [12]. В основе лежит теория функционала плотности (DFT); в качестве принципиального расчетного базиса используются плоские волны и псевдопотенциалы. Периодическая структура кристалла учитывается через граничные условия на границе элементарной ячейки.

В расчете использовались следующие электронные конфигурации: для атомов Si —  $[Ne]3s^23p^23d^0$ , для атомов N —  $[He]2s^22p^3$ . Для атомов Si электроны в состояниях  $3s^23p^2$  относились к валентным оболочкам, электроны в полностью заполенной оболочке [Ne] относились к остову. Для атомов N электроны в состояниях  $2s^22p^3$  относились к валентным оболочкам, электроны в полностью заполенной оболочке [He] относились к остову. Влияние основных электронов учитывалось путем использования ультрамягких (ultrasoft Vanderbilt) псевдопотенциалов. Использовался нелокальный обменнокорреляционный функционал в параметризации Perdew–Вигке–Егпzerhof. Энергия обрезания плоских волн для самосогласованного расчета (SCF) выбиралась таким

образом, чтобы получить сходимость по полной энергии ячейки не хуже 0.001 Ry/atom, и равнялась 50 Ry. Плотность сетки *k*-точек в обратном пространстве для SCF-расчета выбиралась из таких же соображений.

Численная оценка эффективных масс электронов и дырок проводилась по полученной совокупности точек E(k) в зоне Бриллюэна путем аппроксимации дисперсионной кривой параболой в окрестности локального экстремума. Для точного определения положения экстремальных точек (вершины валентной зоны и дна зоны проводимости) и получения плотной дискретной сетки в окрестности экстремумов проводились дополнительные несамосогласованные (non-SCF) расчеты с помощью полученных в предыдущем SCF-расчете потенциалов.

# 3. Результаты и обсуждение

Зона Бриллюэна для  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> предствлена на рис. 2. Для  $\beta$ -фазы картина качественно похожа, обратная ячейка более вытянута вдоль оси шестиугольной призмы. На рисунке показаны уникальные точки симметрии и путь в обратном пространстве, вдоль которого строилась дисперсионная зависимость E(k), приведенная на рис. 3 ( $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) и рис. 4 ( $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>).



**Рис. 2.** Первая зона Бриллюэна для α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Приведены уникальные точки симметрии.





Рис. 4. Зонная структура  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>.

Парциальная плотность состояний (ППС) для Si 3s, 3p и N 2p в  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> и  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, а также экспериментальные спектры эмиссии и поглощения аморфного Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, взятые из [13], совмещенные в единой энергетической шкале, представлены на рис. 5 и 6. За начало отсчета энергии принято положение верха валентной зоны E<sub>v</sub>. Расчетные ППС для обеих фаз очень близки и качественно совпадают.

Рентгеновские спектры эмиссии и поглощения в дипольном приближении позволяют определить симметрию волновых функций электронов, которые формируют валентную зону и зону проводимости диэлектрика. Детали интерпретации рентгеновских спектров приведены в [1].

В соответствии с экспериментом валентная зона a-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> состоит из двух подзон, разделенных ионной щелью. В стандартной интерпретации нижняя валентная зона сформирована 2s-орбиталями азота с примесью 3s-, 3р-состояний кремния. Верхняя валентная сформирована 2*p*-орбиталями азота и 3*s*-, 3*p*-орбиталями кремния. В Si L<sub>2.3</sub>-рентгеновских спектрах эмиссии проявляются переходы из валентной зоны на внутренний атомный Si 2*p*-уровень. В соответствии с дипольными правилами отбора на Si 2p-уровень разрешены переходы с Si 3s-состояний (одноцентровые локальные переходы). На рис. 5, а и 6, а представлена расчетная парциальная плотность Si 3s-состояний. Верхний пик при энергии  $\approx -8\,\mathrm{eV}$  в расчетной ППС близок к положению соответствующего пика в Si L2.3-спектре эмиссии. Пик с энергией  $\approx -3 \,\mathrm{eV}$  в экспериментальном Si  $L_{2,3}$ -спектре эмиссии обусловлен, как это показано в [14], вкладом Si 3d-состояний, не занятых в свободном атоме кремния, и вкладом двухцентровых переходов.

Следует отметить, что хотя в расчетный базис были включены 3d-состояния для Si, парциальные плотности для них не приводятся. Корректная интерпретация Si L2.3-спектра эмиссии требует точного расчета дипольных матричных элементов перехода, включая вклады от нелокальных переходов (двухцентровые N  $2p \rightarrow \text{Si} 2p$ ), что выходит за рамки данной работы. Более точный учет этих переходов приведен в работе [14].

Анализ заселенности по Лоудину позволил определить эффективные заряды на атомах кремния и азота в  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>: для Si q = 2.49e, для N q = 6.02e. Поскольку атом кремния в Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> координирован четырьмя атомами азота, а атом азота — тремя атомами кремния, рассчитанный перенос заряда на связь Si-N составляет  $\approx 0.37e$ . Эта величина близка к экспериментальному значению 0.35е [1]. Эффективные заряды и перенос заряда на связь Si-N в β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> практически не отличаются от  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>.

Значения эффективных масс для электронов и дырок в обеих модификациях Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> приведены в таблице. Анализ зонной структуры *α*-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> позволяет сделать вывод, что этот материал является непрямозонным диэлектриком. Верх валентной зоны расположен в точке К зоны Бриллюэна. Во всей плоскости ГКМ (плоскость, перпендикулярная оси призмы, см. рис. 1, 2) значения



Рис. 5. Рассчитанные парциальные плотности (сплошные линии) состояний для  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> в сравнении с экспериментальными рентгеновскими спектрами эмиссии и поглощения (штриховые линии) для аморфного Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>.



Рис. 6. Рассчитанные паршиальные плотности состояний (сплошные линии) для β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> в сравнении с экспериментальными рентгеновскими спектрами эмиссии и поглощения (штриховые линии) для аморфного Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>.

Компоненты тензора эффективных масс	$lpha$ -Si $_3N_4$		$\beta$ -Si $_3N_4$	
$m_{ m e}^{*\parallel}$	0.79(Γ– <i>A</i> )		0.23(Γ– <i>A</i> )	
$m_{ m e}^{*\perp}$	1	0.5	1.6	
	$(\Gamma - K; \Gamma - M)$	$(\Gamma - K; \Gamma - M)$	$(\Gamma - K; \Gamma - M)$	
$m_{ m h}^{*\parallel}$	0.5		2.9	1.5
	(M-L)		(верх $VB - \Gamma$ )	(Bepx  VB - A)
$m_{ m h}^{*\perp}$	$\begin{array}{c} 6\\ (M-\Gamma; M-K) \end{array}$		0.85	
			(перпендикулярно $\Gamma - A$ )	

Компоненты тензоров эффективных масс электронов и дырок (в единицах  $m_0$ ) в  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> и  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> для двух направлений вдоль шестиугольной призмы: перпендикулярно  $(m_e^{*\perp}, m_h^{*\perp})$  и параллельно  $(m_e^{*\parallel}, m_h^{*\parallel})$  ее оси

Примечание. В  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, где наблюдается вырождение на дне зоны проводимости в Г-точке, снимающееся в направлении, перпендикулярном оси призмы, приведены два значения компоненты  $m_e^{*\perp}$ , соответствующие двум вырожденным зонам. В  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, где значение компоненты  $m_h^*$ , параллельной оси призмы, зависит от направления вдоль оси, приведены два значения  $m_h^{*\parallel}$ .

энергии очень близки. В результате этого получаем большие значения эффективных масс  $m_h^*$  для дырок в этой плоскости. Значение эффективной массы  $m_h^*$  в направлении, перпендикулярном плоскости ГКМ, равно  $m_h^* \approx 0.5m_0$ , что близко к экспериментальным данным:  $(0.4-0.5)m_0$ .

Дно зоны проводимости расположено в центре зоны Бриллюэна Г (рис. 3). Здесь наблюдается вырождение по энергии, которое снимается при движении перпендикулярно оси призмы (направления  $\Gamma \to M$  и  $\Gamma \to K$ ) и остается при движении параллельно оси призмы (направление  $\Gamma \rightarrow A$ ). Неучет этого вырождения привел к завышению эффективной массы электронов в 2 раза в работе [10]. С учетом вырождения эффективная масса "легких" электронов составляет  $m_{\rm e}^* \approx 0.5 m_0$ , что близко к экспериментальным данным: (0.4-0.5)m<sub>0</sub>. Расчетная ширина запрещенной зоны α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> составляет 4.5 eV. Это значение хорошо совпадает с результатами оптических измерений аморфного нитрида кремния [2] и ширины запрещенной зоны, определенной с помощью измерения барьеров для инжекции электронов и дырок [4].

Как и  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>,  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> является непрямозонным диэлектриком. Анализ зонной структуры  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> (рис. 4) показывает ряд заметных отличий от  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Вершина валентной зоны смещена из точки  $\Gamma$  в направлении точки A (рис. 2, 4). На рис. 7 приведен вид поверхности



Рис. 7. Поверхность постоянной энергии в зоне Бриллюэна для β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>.

постоянной энергии в зоне Бриллюэна для  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. На рисунке хорошо заметно, что поверхность постоянной энергии имеет форму эллипсоида вращения с одной половиной, сжатой по оси шестиугольной призмы. Вид дисперсии E(k) и величина эффективной массы зависят от направления вдоль оси призмы. Тот факт, что вершина валентной зоны  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> не находится в точке симметрии зоны Бриллюэна, приводит к кардинальному отличию эффективных масс дырок  $m_h^*$  по сравнению с  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Дно зоны проводимости  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> находится в точке Г. Вырождения, характерного для  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, не наблюдается.

# 4. Заключение

В настоящей работе проведено детальное изучение зонной структуры и эффективных масс электронов и дырок в  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> и  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Расчет очень хорошо описывает экспериментально наблюдаемый перенос заряда по связи Si–N.

Согласно расчетам, "легкие" электроны и дырки в  $\alpha$ -фазе имеют эффективную массу  $m_e^* \approx m_h^* \approx 0.5 m_0$ , что хорошо согласуется с экспериментальными массами в аморфном a-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Из-за особенности в положении вершины валентной зоны в  $\beta$ -фазе (она смещена в направлении  $\Gamma$ -A и не находится в точке симметрии зоны Бриллюэна) и отсутствия вырождения на дне зоны проводимости тензоры эффективных масс электронов и дырок в  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> существенно отличаются от соответствующих тензоров в  $\alpha$ -фазе.

# Список литературы

- В.А. Гриценко. Строение и электронная структура аморфных диэлектриков в кремниевых МДП-структурах. Наука, Новосибирск (2003). 280 с.
- [2] V.A. Gritsenko. In: Silicon nitride in electronics / Ed. A.V. Rhzanov. Elsevier, N.Y. (1986). 286 p.

- [3] V.A. Gritsenko, K.A. Nasyrov, Yu.N. Novikov, A.L. Aseev, S.Y. Yoon, J.-W. Lee, E.-H. Lee, C.W. Kim. Solid State Electron. 47, 1651 (2003).
- [4] V.A. Gritsenko, E.E. Meerson, Yu.N. Morokov. Phys. Rev. B 57, 2081 (1997).
- [5] К.А. Насыров, Ю.Н. Новиков, В.А. Гриценко, С.Ю. Юн, Ч.В. Ким. Письма в ЖЭТФ 77, 455 (2003).
- [6] K.A. Nasyrov, V.A. Gritsenko, Yu.N. Novikov, E.-H. Lee, S.Y. Yoon, C.W. Kim. J. Appl. Phys. 96, 4293 (2004).
- [7] В.А. Гриценко, С.С. Шаймеев, К.А. Насыров. ЖЭТФ 129, 926 (2006).
- [8] ICSD database 2003 Collection; http://icsd.ill.fr/icsd/index.html, Entry #92156.
- [9] ICSD database 2003 Collection; http://icsd.ill.fr/icsd/index.html, Entry #79798.
- [10] S.-Y. Ren, W.Y. Ching. Phys. Rev. B 23, 5454 (1981).
- [11] Yong-Nian Xu, W.Y. Ching. Phys. Rev. B **51**, 24 (1995).
- [12] S. Baroni, A. Dal Corso, S. de Gironcoli, P. Giannozzi, C. Cavazzoni, G. Ballabio, S. Scandolo, G. Chiarotti, P. Focher, A. Pasquarello, K. Laasonen, A. Trave, R. Car, N. Marzari, A. Kokalj. http://www.pwscf.org/.
- [13] V.A. Gritsenko, Yu.N. Morokov, Yu.N. Novikov. Appl. Surf. Sci. 113/114, 417 (1997).
- [14] В.А. Гриценко, Ю.Н. Новиков, А.В. Шапошников, Ю.Н. Мороков. ФТП 35, 1041 (2001).